

最新の三次元表面性状パラメータと測定法講習会のご案内

精密なものづくりにおいて必要不可欠な表面性状（表面粗さ）の規格に、ISO が 2010 年から三次元表面性状パラメータ関連の新規格を公布しています（ISO 25178：JISB0681）。本講習会では、この新規格に関する最新の情報をご提供すると共に、三次元表面性状測定のための代表的な測定法について実機を用いながら紹介いたします。今後更なる付加価値が求められる精密部品の製造、品質管理に必要な情報ですので奮ってご参加いただけますようご案内申し上げます。

記

- 1 開催日時 平成 27 年 7 月 3 日（金） 13:00～17:00（10:00～12:00 でサンプル測定可能）
- 2 開催場所 埼玉県産業技術総合センター 4F 4ABC 会議室
（〒333-0844 埼玉県川口市上青木 3-12-18 TEL 048-265-1312）
※会場へのアクセスは以下の web サイトをご覧ください

<http://www.saitec.pref.saitama.lg.jp/acceEtc/access-2.html>

- 3 主催 埼玉県産業技術総合センター

4 内 容

12:30～13:00 受付

13:00～13:30 ①開催の挨拶

②三次元表面性状のパラメータと測定法について

ISO 25178-2（用語、定義及び表面性状パラメータ）

ISO 25178-3（完璧な仕様オペレータ）

ISO 25178-6（測定法の分類）

講師：佐藤 敦（キヤノンマーケティングジャパン(株)、ISO/TC213 国内対応委員）

・・・代表的な測定法の説明・・・

13:30～14:10 ISO 25178-604：垂直走査形低コヒーレンス干渉法

(Coherence scanning interferometry,CSI)

【対物レンズの倍率に依らず均一な垂直分解能を有し短時間の測定が可能】

講師：佐藤慶一（キヤノンマーケティングジャパン(株) ZYGO 技術課 チーフ）

14:10～14:30 休憩

14:30～15:10 ISO 25178-605：点合焦式輪郭曲線法(Point autofocus profiling)

【オートフォーカスとステージ走査法により広範囲、高分解能測定が可能】

講師：三浦勝弘（三鷹光器(株) 開発室長）

15:10～15:50 ISO 25178-607：共焦点顕微鏡法(Confocal microscopy)

【平面分解能にすぐれた対物レンズを使用する事により、急斜面の形状測定に対応】

講師：牛丸元春（オリンパス(株)、産業ソリューション営業部）

10:00～12:00 及び 15:50～17:00・・・各測定機の実機展示及びサンプル測定

講習会に参加した3社が下記測定器を実機展示しますので、サンプル（最大 100mm□、重さ 5kg まで）を持ち込んで頂ければ測定対応が可能です。お試下さい。

キヤノンマーケティングジャパン(株) 新世代 3 次元光学プロファイラー「Nexview」

三鷹光器(株) 非接触表面性状測定装置「PF-60」

オリンパス(株) レーザー顕微鏡「LEXT OLS4100」

5 定 員 50 名（定員になり次第、締め切りとさせていただきますのでご了承ください）

6 参加費 無 料

7 申込方法 6 月 29 日（月）までに別添の申込書にて、FAX または E-mail でお申込み下さい。

＜問合せ先＞ 埼玉県産業技術総合センター

事業化支援室 山川

TEL 048-265-1312(代表) FAX 048-265-1334

(別紙)

FAX : 048-265-1334

E-mail : h6513112@pref.saitama.lg.jp

埼玉県産業技術総合センター 事業化支援室 山川 行

※6/29(月)までに送付をお願いします

技術講習会

「最新の三次元表面性状パラメータと測定法」

平成27年7月3日(金) 13:00~17:00

受講申込書

貴社名 _____

TEL _____

FAX _____

ご参加者名 _____

サンプル測定の希望

_____ 希望する

_____ 希望しない

※サンプル形状(大きさ、重さ等)、希望測定内容についてご記入下さい

